부

령

●기획재정부령 제685호

관세법 시행규칙 일부개정령을 다음과 같이 공포한다.

2018년 7월 19일

기획재정부장관 인

관세법 시행규칙 일부개정령

관세법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1을 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(관세가 감면되는 산업기술 연구·개발용 물품에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 수입신고한 물품에 대해서는 별표 1의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

[별표 1]

법 제90조제1항제4호에 따라 관세가 감면되는 산업기술 연구·개발용 물품
(제37조제4항제1호 관련)

연번	관세율표 번호		품명	규격
	호	소호		
1	8413	50	펌프	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 고분자 중합용 다이어프램 펌프(Diaphragm Pump)로서 작동가능 온도가 영하 50도(℃)부터 영상 150도까지이고 작동가능 압력이 35메가파스칼(MPa) 이하인 것 2. 평판디스플레이 제조용 터보 몰레큘러펌프(Turbo molecular Pump)로서 진공도(Torr)가 10 ⁻³ 이하인 것
	8414	10		
2	8419	89	냉각기	영하 35도(℃) 이하로 냉각 또는 냉동할 수 있는 것
3	8419	89	반응기 (Reactor)	반응온도가 75도(℃)부터 350도까지로서, 내부압력이 감압상태인 0.001바(bar)부터 가압상태인 120바 이내의 조건에서 중합물을 제조할 수 있는 1리터(L) 이상 용량의 것
4	8419	89	열충격시험기 (Temperature Shock Test Chamber)	평판디스플레이, 인쇄회로기판, 반도체소자 또는 반도체모듈의 성능을 시험하는 것으로서, 설정 가능한 최고온도가 영상 100도(℃) 이상이고 최저 온도가 영하 40도 이하인 것
5	8419	89	부식성시험기 또는 복합사이클부식시험기	측정 대상물의 부식 정도를 시험할 수 있는 것으로서 건조, 습도, 염수, 온도, 이산화탄소 농도, 광 조사(光照射) 또는 결로(結露) 중 두 가지 이상의 시험 조건을 설정할 수 있는 것
	9031	80		

6	8419 8479	89 89	항온항습기 (항온기, 항습기 및 항습배양기를 포함한다)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 온도의 허용 오차 범위가 ± 3.0 도($^{\circ}\text{C}$) 이하이거나 습도의 허용 오차 범위가 ± 5 퍼센트(%) 이하인 것 2. 사용온도가 영상 100도 이상이거나 영하 40도 이하인 것 3. 70분 내에 영하 40도에서 영상 150도까지 온도를 상승시 킬 수 있는 것
7	8419 8479 9031	89 89 80	온도습도시험기 또는 고온고습시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 온도를 영하 20도($^{\circ}\text{C}$)부터 영상 100도까지 설정할 수 있 고, 상대 습도(RH)를 20퍼센트(%)부터 98퍼센트까지 설 정할 수 있는 것 2. 챔버(Chamber) 내부의 온도를 105도부터 150도까지 조 절할 수 있고 챔버 내부의 상대 습도(RH)를 65퍼센트부 터 100퍼센트까지 조절할 수 있는 것
8	8419 8479 9031	89 89 80	환경 챔버 (Chamber) (항온항습챔버를 포함한다)	온도, 습도, 시간, 조명도(照明度) 또는 사이클(Cycle)의 조정 이 가능한 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것 으로 한정한다. 1. 온도의 허용 오차 범위가 ± 3.0 도($^{\circ}\text{C}$) 이하인 것 2. 습도의 허용 오차 범위가 ± 5.0 퍼센트(%) 이하인 것 3. 열 스트레스(stress)를 가함으로써 시료의 열내구성을 측 정할 수 있는 것
9	8421	19	원심 분리기 (Centrifugal Separator)	원심 분리 1회 용적이 250밀리리터(mL) 이상이고 분당 회 전수가 30,000알피엠(rpm) 이상이며 원심분리기내 재료가 받는 힘의 크기가 20,000중력(G) 이상인 것
10	8424	89	수용성 미스트 분사장치	유해물질을 함유하지 않은 전용의 수용성 미스트액을 분사 시켜주는 장치인 것
11	8424 8479	20 89	전동유동코팅건조기	리튬이차전지용으로 코팅용 용액을 투입하여 원재료를 코팅 하는 방식인 것으로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것일 것 1. 급기(給氣) 온도가 60도($^{\circ}\text{C}$)부터 80도까지일 것 2. 급기 풍량이 분당 0.2세제곱미터(m^3)부터 1.0세제곱미터 까지일 것
12	8455 8479	10 89	관 압연기 (Tube Mills), 공압확관기 (Air Pressure Expander)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 0.2밀리미터(mm) 이하의 압연관재를 튜브(Tube) 형상으 로 가공할 수 있는 것 2. 30메가파스칼(MPa) 이하의 고압 공기로 바깥지름이 9.52밀 리미터 이하의 관(Tube) 내부 형상을 가공할 수 있는 것
13	8456	11	레이저 가공장치 또는 레이저 마커 (Laser Marker)	가공점 위치의 오차 범위가 ± 3 마이크로미터(μm) 이하인 것

14	8456	11	이온빔 장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 이온빔(Ion Beam) 또는 전자빔(Electron Beam)을 이용하여 반도체웨이퍼 또는 시편(試片)을 가공할 수 있는 것 2. 투과전자현미경(Transmission Electron Microscope) 또는 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope)을 이용하여 제품의 불량 여부를 분석하거나, 분석을 위한 박편(薄片) 및 단면시료(試料)의 제작이 가능한 것 3. 플라즈마 이온빔(Plasma Ion Beam)을 시편(試片)에 직접 조사(照射)하여 전하를 띠게 하는 것 4. 가속전압이 1킬로볼트(kV) 이상 40킬로볼트 이하인 아르곤(Ar) 또는 갈륨(Ga) 이온총(Ion Gun)을 장착한 것
	8456	12	(Ion Beam System)	
	8456	90	[집속(集束) 이온빔	
	8479	89	장치를 포함한다],	
	9012	10	이온밀링장치 (Ion Milling System) (이온빔 식각장치를 포함한다)	
15	8456	11	레이저발진기	레이저 파장이 1,340나노미터(nm) 이하인 것
	9013	20		
16	8456	30	절단기,	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 웨이퍼(Wafer), 시편(試片), 이차전지용 전해질 필름, 완성반도체(한 개의 기판에 봉합된 다수의 반도체를 포함한다) 또는 반도체 반제품을 절단하거나 클리브(Cleave)할 수 있는 것 2. 와이어 이송속도(Wire Feed Speed)가 분당 2,000밀리미터(mm) 이상인 것
	8479	89	마이크로클리빙기	
	9027	90	(Cleaving Machine) 또는 와이어커팅기 (Wire Cutting Machine)	
17	8456	90	연마기, 연마기시스템	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 반도체, 웨이퍼, 웨이퍼상의 수지(Resin), 평판디스플레이, 평판디스플레이용 글래스(Glass), 인쇄회로기판, 워 shaft(Worm Shaft), 스퀴지(Squeegee) 또는 패키지몰드(Package Mold) 연마용인 것 2. 상판과 하판을 동시에 연마가공할 수 있는 것 3. 수분을 포함한 습식연마재를 사용하여 곡면과 요철 부위를 연마할 수 있는 것 4. 버티컬(Vertical) 방식으로 절삭공구, 기어 등의 내경을 연마가공할 수 있는 것 5. 전자현미경 분석을 위한 시편 가공장치로서 전해액을 이용하여 연마작업을 할 수 있는 것
	8460	24	또는 광택기	
	8460	40		
	8460	90		
	8464	20		
18	8457	10	머시닝센터	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 선반과 밀링(milling)을 융합한 복합가공기능이 있는 것. 2. 복합머시닝센터로서 머시닝(machining), 선삭 및 연삭기능을 모두 융합한 복합가공기능이 있는 것 3. 수치제어방식으로서 보조회전축(Sub-spindle)을 활용하여 앞뒤로 절삭가공이 가능한 것
	8458	11	(Machining Center) 또는 터닝머신	

19	8460 8460 8460 8460 8461	24 29 31 39 40	연삭기	<p>수치제어 방식으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 기어 프로파일(Gear Profile) 연삭이 가능한 것 2. 기어 호브 커터(Gear Hob Cutter) 또는 브로치 커터(Broach Cutter)의 프로파일(Profile)이나 날 연삭이 가능한 것 3. 드릴, 엔드밀 또는 인서트(Insert)의 홈, 여유면, 날끝각(Point) 또는 스플릿 포인트(Split Point)를 가공하는 전용 연삭기로서, 가공지름이 0.05밀리미터(mm) 이상 80밀리미터(mm) 이하인 것 4. 스카이빙(Skiving) 공구를 장착하여 내치기어(Internal Gear) 또는 외치기어(External Gear)를 가공할 수 있는 것 5. 3차원 형상의 공구를 연삭할 수 있는 것 6. 제품의 외경과 단면을 동시에 연삭할 수 있는 것 7. 패널레벨패키징(PLP)기판을 휠(wheel)로 연마하여 평탄화할 수 있는 것
20	8460	40	호닝 머신 (Honing Machine)	서보(Servo) 모터로 작동하는 상하구동식 연마기로서, 내부 지름이 12밀리미터(mm) 이상 50밀리미터 이하인 물체를 연마할 수 있는 것
21	8462 8462 8462 8479	21 29 99 89	정밀금속절곡기 (Bending Machine)	자동으로 철재강판을 전단(Shearing) 및 절곡(Bending)할 수 있는 것으로서 2차원 또는 3차원 형상가공 시 가공오차 범위가 ± 0.3 밀리미터(mm) 이하인 것
22	8462 8479	99 89	등방가압 (等方加壓) 프레스	압력용기의 내부 지름이 130밀리미터(mm) 이상이거나 압력용기의 길이가 400밀리미터 이상이고, 최대 500메가파스칼(MPa) 이상의 압력을 가할 수 있는 것
23	8463 8477 8479	90 59 89	3차원 프린터 (3D Printer)	<p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 0.05밀리미터(mm) 이상의 정밀 적층(積層)이 가능한 것 2. 20마이크로미터(μm) 이하의 선폭으로 패터닝(patterning)이 가능한 것
24	8477 8477 8479 8479	10 59 81 89	사출성형기 또는 필름성형기	<p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 프레스(Press) 방식인 것으로서, 비구면 실리콘렌즈 또는 비구면 유리의 성형이 가능하거나 성형압력이 300바(bar) 이상인 것 2. 수지 또는 금속 사출장치와 액상 주입장치를 모두 갖추고 있는 것 3. 스크류 구동방식이 전동식인 것 4. 특수사출기로서 이중사출과 350톤(ton) 이상의 형체력을 갖는 사출압축이 모두 가능한 것 5. 50마이크로미터(μm) 이하의 필름을 성형할 수 있는 것

25	8477	20	압출기	1축 또는 2축 압출가공(押出加工) 연구용으로서 온도제어 범위가 100도(℃) 이상 400도 이하인 것
26	8477	80	타이어 버핑(Buffing)기	타이어를 고정할 수 있는 지그(Jig)와 버핑(Buffing)용 샌드페이퍼가 설치되어 있고, 고무 분진을 모을 수 있는 집진기가 있는 것
27	8479 8537	50 10	동작제어기 (Motion Controller)	서보(Servo) 모터를 구동하여 3축 이상의 로봇동작을 구현할 수 있는 것
28	8479 8479	81 89	세척기 또는 세정기	웨이퍼, 시편(試片), 마스크, 마스크용기, 레티클(Reticle), 레티클 용기, 반도체, 유기발광다이오드기판, 절삭공구류 표면의 산화막, 유기물, 웨이퍼 카세트(Wafer Cassette), 웨이퍼 프레임(Wafer Frame) 또는 인쇄회로기판을, 화공약품, 초음파, 플라즈마(Plasma), 자외선, 깨끗한 물, 스프레이, 반응가스(Ar, O ₂ , H ₂) 또는 증기를 이용하여 세척할 수 있는 것
29	8479 8479 8486 8543	81 89 30 30	도금기, 도포기(Coater) 또는 코팅머신 (Coating Machine)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 자동차 피스톤링(Piston Ring)에 다이아몬드-라이크 카본(DLC, Diamond Like Carbon) 또는 4면체 비정질 탄소(TAC, Tetrahedral Amorphous Carbon)를 코팅할 수 있는 것 2. 로드(Rod) 증발원을 탑재하여 아크 스팟(Arc Spot)의 위치와 막 두께의 분포를 자동으로 제어할 수 있는 것 3. 디스펜서(Dispenser) 방식(패턴형성기능을 포함한다), 전자빔(Electron Beam) 방식, 회전 방식, 이온빔(Ion Beam) 방식, 스프레이코터(Spray Coater) 방식 또는 슬롯다이(Slot-die) 방식 또는 담금(Dipping) 방식인 것 4. 자동차 피스톤링(PistonRing)이 고착(Sticking)되는 현상을 방지하는 코팅(RNS-M, Anti-sticking Coating)을 할 수 있는 것 5. 0.4밀리미터(mm) 이상 1밀리미터 이하의 두께로 컬러(Color) 코팅이 가능한 것 6. 2개 이상의 재료를 멀티 코팅(multi layer coating)할 수 있는 것 7. 가로 415밀리미터 × 세로 510밀리미터, 가로 400밀리미터 × 세로 500밀리미터 크기의 인쇄회로기판에 전기동의 도금이 가능한 것
30	8479	82	혼합기	실험용 소형 분쇄혼합기로서 혼합과 분쇄 기능이 있는 것
31	8479	89	포집기 (Collector) 또는 가스농축기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 평판디스플레이용 유기기판에 열탈착을 이용하여 고체, 액체 또는 기체로부터 미량의 휘발성분을 포집할 수 있는 것 2. 자외선 경화형 수지(Resin), 플라스틱 또는 평판디스플레이의 샘플에 자외선을 조사(照射)하거나 가열 시 발생하는 가스를 포집하여 농축할 수 있는 것

32	8479	89	고농도 알칼리 이온수 생성장치	수소이온농도가 13.1피에어치(pH)부터 13.2피에어치까지인 고농도 알칼리 이온수 80리터(L)를 연속 생성하여 내부 펌프로 외부로부터 급수하는 장치인 것
33	8479	89	가스분무 분말제조기 (Gas Atomizer)	금속분말을 제조하는 장비로서 최대 1,600도(℃)의 온도로 금속 등을 용해하여 가스와 함께 분사할 수 있는 것
34	8479	89	자동열탈착기 (Automated Thermal Desorber) 또는 퀴리(Curie)점 열분해기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 시료 중의 휘발성 물질을 열탈착시켜 흡착튜브에 흡착·포집한 후 가스 크로마토그래피(Gas Chromatography)에 주입하여 분석할 수 있는 것 2. 전류가 흐르는 동안 퀴리점을 유지시키면서 발생하는 시료의 열분해물 샘플을 가스 크로마토그래피(Gas Chromatography)에 주입하여 분석할 수 있는 것 3. 시료 중의 휘발성 물질을 열탈착시킨 후 질량에 따라 분리하여 정량 또는 정성 분석을 할 수 있는 것
35	8479	89	칩 마운터 (Chip Mounter)	인쇄회로기판 표면 위에 각종 칩, 능동·수동소자 등의 전자부품을 자동으로 탑재하고 부착할 수 있는 것
36	8479	89	다이(Die) 부착기	스테이지(Stage)와 헤드(Head)의 온도를 제어하여 칩(Die)을 기판(Core)에 부착할 수 있는 것
37	8479	89	바렐형 증착기 (Barrel Sputter)	증착하려는 재료의 수가 2개 이상이며, 전도성 또는 절연체 재료에 증착이 가능한 것
38	8479 8543	89 70	제진대(除震臺) 또는 자동제진시스템	건물 진동을 제어하는 것으로서 액티브 타입(Active Type)인 것
39	8479 9025 9031	89 80 80	저온필터 막힘점 시험기	경유의 저온필터 막힘점 평가용으로 미국재료시험협회(American Society for Testing and Materials)의 경유저온필터막힘점시험법(D6371)의 시험이 가능한 것
40	8479 9030 9030 9030 9031	89 39 84 89 80	연료전지 평가장비	최대출력이 10킬로와트(kW) 이상 100킬로와트 이하인 연료전지의 스택(Stack)을 평가할 수 있는 것
41	8479 9030 9030 9031 9031	89 84 89 49 80	성능 시험기 또는 성능 측정기	반도체, 메모리모듈, 인쇄회로기판, 평판디스플레이, 평판디스플레이용 장비 또는 태양전지의 전기적, 물리적, 광학적 또는 화학적 특성을 측정, 시험 또는 검사하는 것
42	8486	30	리페어기 (Review Repair)	평판디스플레이의 회로를 레이저 빔(Laser Beam) 또는 연마테이프를 이용하여 수정할 수 있는 것

43	8502 8504 8504 8504 8537	39 33 34 40 10	전원 공급기 또는 전압 공급기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전압이 35볼트(V) 이상이거나 전류가 2암페어(A) 이상인 것 2. 정격 출력이 2메가볼트암페어(MVA) 이상이거나 1킬로와트(kW) 이상인 것 3. 임의파(Arbitrary Waveform) 발생이 가능한 것
44	8514 8514 8514 8514	10 20 30 40	노(爐, Furnace), 오븐, 열처리장치 또는 열압축가공기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전기로(電氣爐)로서 최고온도가 500도(°C) 이상이고 온도의 허용 오차 범위가 ±8도 이하인 것 2. 가열 시 내부 온도를 측정할 수 있는 것 3. 전기가열방식의 열처리장치로서 진공상태에서 최고온도가 1,200도 이상인 것 4. 온도를 설정할 수 있고 노 내부에 산소제거를 위하여 질소 또는 아르곤을 충전할 수 있는 것 5. 외부공기가 시간당 60회 이상 순환되고, 전기가열 방식을 통하여 온도를 상온에서 300도까지 조절할 수 있는 것 6. 열을 표본에 잘 전달하기 위한 고리가 장착되어있고 분당 5회 이상 10회 이하로 회전하며 과열감지기가 설치되어 있는 것 7. 자동차 피스톤 링(Piston Ring)의 귀부(Tab)에 30마이크로미터(μm) 이상의 질화층(깊이)을 형성할 수 있는 것
45	8525 9025 9031	80 19 80	열화상카메라, 산업용 내시경카메라 또는 근적외선 카메라	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 초당 30프레임(Frame) 이상을 처리할 수 있는 것 2. 적외선을 이용하는 것으로서 분광(Spectrum) 범위의 최대 값이 10마이크로미터(μm) 이상인 것 3. 적외선 발광소자의 발광량을 측정할 수 있는 카메라로서 측정 가능한 파장영역이 0.9마이크로미터 이상 1.7마이크로미터 이하의 센서를 갖춘 것
46	8537 8543	10 70	스위치제어 시스템	최대 제어 가능한 스위치의 수가 20개 이상인 것
47	8537 9024 9024 9031	10 10 80 80	피로시험기 또는 내구시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 유압방식, 자기 공명 주파수(Magnetic Resonance Frequency)방식 또는 모터구동방식으로서, 온도 변화의 피로시험을 수행하거나 내구[인장(引張), 굽힘, 압축 또는 비틀림] 피로시험을 수행할 수 있는 것 2. 자동차용 타이어의 피로수명(내구력)을 측정할 수 있는 것으로서 속도, 하중, 시간, 슬립(Slip) 또는 캠버(Camber)를 조절할 수 있는 것

48	8543 8543 9030 9030	20 70 84 89	신호발생기, 시그널에뮬레이터(Sig nal Emulator), 주파수발생기, 과도파형 발생기, 펄스발생기 또는 펄선 임의파형 발생기(Function Generator)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 평판디스플레이패널을 구동하기 위한 영상신호를 발생시키는 것 2. 감쇠(減衰) 정현파(Sine Curve) 발생용으로서 발생주파수가 100메가헤르츠(MHz) 이상인 것 3. 입력채널(Channel) 수가 4개 이상인 것 4. 주파수가 2,450메가헤르츠 이상인 것 5. 에이엠(AM, Amplitude Modulation) 변조, 에프엠(FM, Frequency Modulation) 변조 또는 무변조캐리어(CW, Continuous Wave)가 가능한 것 6. 1헤르츠(Hz) 이하의 저주파 발생이 가능한 것 7. 전압을 걸어 무선주파수(Radio Frequency)로 전력을 송출할 수 있는 것 8. 임의파(Arbitrary Wave-form) 발생이 가능한 것 9. 단락 전류(Short Circuit current)가 300암페어(A) 이하인 것
49	8543	70	주파수 교정기	교정 가능한 무선 주파수의 범위가 300킬로헤르츠(kHz)이상 9기가헤르츠(GHz)이하인 것
50	8543	70	무선 주파수 신호 수신기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 방송신호를 기록할 수 있는 것 2. 방송신호가 갈무리(Capture)된 기기로부터 기록된 신호를 공유하는 방법으로 신호를 재생할 수 있는 것
51	8543 9030 9030 9030 9030	70 33 39 84 89	신호분석기, 신호소스분석기 또는 신호측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 부호분할다중접속(CDMA), 이동통신세계화시스템(GSM), 위성위치확인시스템(GPS), 광대역부호분할다중접속(WCDMA), 고속하향패킷접속(HSDPA), 엘티이(LTE), 글로나스(GLONASS) 또는 고속상향패킷접속(HSUPA)의 신호를 측정할 수 있는 것 2. 입력 주파수가 30킬로헤르츠(kHz) 이상이거나 주파수 범위가 3헤르츠(Hz) 이상인 것 3. 무선주파수(Radio Frequency) 또는 전자기파(EM) 신호의 특성을 측정 및 분석 가능한 것 4. 주파수 범위가 최소 9킬로헤르츠 이상이고 최대 3기가헤르츠(GHz) 이하인 것
52	8543 9030 9030 9030 9031	70 39 84 89 80	정전기 시험기	발생 정전기의 전압이 2킬로볼트(kV) 이상인 것

53	9010	50	노광기(Stepper)	레이저를 사용하여 감광성수지를 경화시키고 인쇄회로기판 제작을 위한 이미지를 형성할 수 있는 것
54	9011	10	현미경	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
	9011	20		1. 전자총이 전계방사(Field Emission)형인 것
	9011	80		2. 2,600파스칼(Pa) 이상의 저진공 상태에서 시료를 관찰할 수 있는 것
	9012	10		3. 광학현미경(Optical Microscope) 또는 형광현미경(Fluorescent Microscope)으로서 영상을 촬영할 수 있고 컴퓨터와 연결할 수 있는 것
	9031	80		4. 투과전자현미경(TEM, Transmission Electron Microscope) 또는 주사형투과전자현미경(STEM, Scanning Transmission Electron Microscope)인 것
				5. 주사전자현미경(SEM, Scanning Electron Microscope)으로서 시료의 표면 상태를 감지하고 분석할 수 있으며 영상처리할 수 있는 것
				6. 광학현미경으로서 입자크기, 표면의 크기, 홀 또는 깊이를 측정할 수 있는 것
				7. 디지털마이크로현미경으로서 3차원 프로파일을 구현할 수 있거나 3차원 측정이 가능한 것
				8. 초음파방식 현미경(Scanning Acoustic Microscope)으로서 관찰대상을 손상 또는 파괴하지 않고 물 등의 액체에 넣은 채로 내부의 결함 여부를 이미지로 관찰할 수 있는 것
55	9018	19	혈압측정기	0.1초 이내의 간격으로 연속 혈압측정이 가능하고 광용적 맥파(PPG)와 심전도(ECG) 신호를 동시에 측정할 수 있는 것
56	9022	19	분광분석기, 형광분석기, 에너지 분산형 분광분석기 또는 파장 분산형 엑스선형광분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
	9022	29		1. 시료에 이온, 이온빔, 레이저, 전자빔 또는 엑스선을 주사(走査)하여 방출되는 에너지 중, 엑스선 또는 광(光)전자를 에너지 준위별(準位別)로 분광시켜 시료를 정성 및 정량 분석할 수 있는 것
	9030	84		2. 컴퓨터 제어방식인 것으로서 주파수가 50킬로헤르츠(kHz) 이상인 것
	9030	89		3. 분광 영역이 100나노미터(nm) 이상이거나 60광학채널(Channel) 이상인 것
	9031	49		4. 2차원 유기성분 분석이 가능한 적외선 분광분석 장치로서 전자식 현미경이 있는 것
	9031	80		

57	9022 9024 9024 9031 9031	19 10 80 49 80	두께측정기, 표면측정기 또는 힘측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 평판디스플레이, 평판디스플레이용 글래스(Glass), 반도체, 반도체용 마스크, 반도체부품, 웨이퍼, 웨이퍼 시료, 렌즈웨이퍼, 이차전지 박막, 태양전지 박막, 연료전지 박막, 인쇄회로기판, 적층세라믹콘덴서(MLCC, Multi-Layer Ceramic Capacitor) 내부 전극 또는 광학용 필름의 측정기로서, 두께, 막질의 두께, 회로선 폭, 입자, 흠집, 단면상태, 뒤틀림 또는 굴곡상태를 측정할 수 있는 것 2. 굴곡상태 또는 표면조도(表面照度)를 측정할 수 있는 것 3. 측정범위가 제트(Z)축은 800마이크로미터(μm), 엑스(X)축은 100밀리미터(mm)이고, 측정분해능이 800마이크로미터 이하에서는 0.01마이크로미터 이하, 80마이크로미터 이하에서는 0.001마이크로미터 이하, 8마이크로미터 이하에서는 0.0001마이크로미터 이하인 것 4. 표면 막의 선얼룩 및 점얼룩을 검출 할수 있는 것 5. 그림자식 모아레(moiré) 간섭계를 이용하여 물체의 굴곡상태를 측정할 수 있는 것
58	9022 9030	19 89	엑스선형광분석기(과장 분산형을 포함한다), 엑스선측정기, 엑스선시험기 또는 엑스선검사기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 형광(Fluorescence), 회절(Diffraction), 분광(Spectrum) 또는 분광광도(Spectrometry)의 기능이 있는 것 2. 엑스선을 이용한 영상처리장치로서, 디지털표시방식이거나 화상분석이 가능한 것
59	9022 9031	19 80	비파괴검사기, 휴대용 X-ray장비	엑스선 방식, 초음파(Ultrasonic Wave) 방식, 레이저 방식 또는 자기장(Magnetic Field) 방식인 것
60	9024 9024 9031	10 80 80	만능시험기, 접착강도시험기, 강도시험기 또는 강성측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 재료의 강도 특성 또는 접합강도 특성 측정용으로서 파괴인성, 파열강도, 충격강도 또는 압축강도를 측정할 수 있는 것 2. 공압을 이용한 낙중방식으로써 시편(試片)의 파괴를 통하여 충격강도를 측정하는 것 3. 힘의 용량을 1킬로뉴턴(kN)까지 측정할 수 있는 것
61	9024 9024 9031	10 80 80	경도시험기, 마모시험기 또는 인장시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 비커스(Vickers) 방식, 탐침(探針) 방식, 연필심 방식, 스크래치 방식 또는 쇼어(Shore) 방식인 것 2. 회전 속도가 분당 200회 이상인 것 3. 고정된 시편(試片)의 아래 판이 움직일 때 시편에 부과되는 힘을 측정하는 방법으로 고무나 플라스틱 등의 마찰계수를 측정할 수 있는 것

62	9024	80	필름 장력 측정기 (Roller Tension Measuring Instrument)	구간별 장력 측정의 분해능이 50뉴턴(N)기준에서 오차범위 ± 1 퍼센트(%)이내까지 측정이 가능한 것
63	9024 9031	80 80	열변형 온도시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 온도 측정 범위가 200도(°C) 이상인 것 2. 측정 물체에 가해지는 하중(Force Range)이 50뉴턴(N) 이하인 것
64	9024 9031	10 80	2축 동특성 측정기 (2-Axial Elastomer Performance Test System)	부시(bush)류의 다축 동강성을 측정하는 장비로서 좌우방향으로 하중을 부가한 상태에서 상하방향으로 700헤르츠(Hz) 이상의 주파수 측정이 가능한 것
65	9025 9025 9031	19 80 80	열상(熱像) 분포측정기, 온도측정기, 온도측정계 또는 표면온도측정장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 영상기록이 가능한 것으로서 온도의 허용 오차 범위가 ± 5 퍼센트(%) 이하인 것 2. 측정 온도의 허용 오차 범위가 ± 1.5 도(°C) 이하인 것 3. 적외선을 이용한 열상(熱像) 기록이 가능한 것 4. 접촉식으로 온도를 측정하는 것 5. 여러 곳의 표면 온도를 동시에 측정할 수 있는 것으로서 동시 측정 가능한 채널(Channel)이 8채널 이상인 것
66	9025 9031	19 80	윤활유 소포성 시험기	윤활유의 기포성을 측정하는 장비로 미국재료시험협회(American Society for Testing and Materials)의 윤활유 기포성 시험법(D892)을 만족하고 온도측정범위가 24도(°C)부터 93.5도까지인 것
67	9027 9031 9031	10 49 80	입자상물질 측정기	입자상물질 채취(採取)부의 필터온도를 47도(°C)를 기준으로 ± 5 도이내로 제어가 가능한 것
68	9027 9031	10 80	총탄화수소 분석기	엔진 시험 중 배출되는 증발 가스에 포함된 총탄화수소(Total Hydrocarbon, THC)를 탄소등가농도 0피피엠씨(ppmC)부터 200,000피피엠씨까지의 범위 내에서 측정 가능하며, 재현성이 풀 스케일(Full Scale)에서 ± 0.1 퍼센트(%)이내인 것
69	9027 9031	10 80	질량분석기 (질량검출기를 포함한다)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 진공상태에서 시료를 가열하고 승화시켜, 온도 변화에 따른 열중량의 변화를 측정하고 질량을 분석할 수 있는 것 2. 가스를 정성 또는 정량 분석할 수 있는 것으로서 시료를 이온화시켜 질량별로 분리할 수 있는 것 3. 진공상태에서 시료를 이온화시켜 질량별로 분석 또는 검출할 수 있는 것

				<p>4. 시료에 이온빔을 주사(走査)하여 방출되는 2차 이온의 비행시간을 측정하는 방식으로 질량을 측정할 수 있는 것</p> <p>5. 크로마토그래피 방식으로 분리된 단일이온을 열과 전압을 주어 이온화하고 이온화된 이온의 질량을 검출할 수 있는 것</p>
70	9027 9031	10 80	가스분석기	<p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <p>1. 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 산소, 수소, 메탄황산화물 또는 암모니아 중 두 가지 이상을 동시에 분석할 수 있는 것</p> <p>2. 세 가지 이상의 가스를 동시에 분석 또는 측정할 수 있는 것</p> <p>3. 풀 스케일(Full Scale) 시 재현성이 ± 1퍼센트(%) 이하인 것</p>
71	9027 9031	10 80	블로바이(Blow-by)가스측정기	자동차의 블로바이(Blow-by) 가스 유량을 측정하는 것으로서 측정 오차 범위가 ± 1.5 퍼센트(%) 이하인 것
72	9027 9031	10 80	매연측정기	자동차 배기가스 측정용으로서 광투과 방식, 여지반사식(濾紙反射式, Filter Paper Method) 또는 광음향(Photo Acoustic) 방식인 것
73	9027 9031	10 80	연소해석기	엔진연소실에서 측정된 엔진연소압 등을 크랭크(Crank) 각도 또는 시간 단위로 취득하여 처리 또는 계산할 수 있는 것
74	9030 9030 9030	20 84 89	오실로스코프(Oscilloscope)	<p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <p>1. 스토리지(Storage) 방식, 포스퍼(Phosphor) 방식 또는 샘플링(Sampling) 방식의 디지털 오실로스코프(Digital Oscilloscope)</p> <p>2. 측정 주파수가 1기가헤르츠(GHz) 이상이거나 입력 채널(Channel) 수가 2개 이상인 것</p> <p>3. 고선명 텔레비전(HDTV, High Definition Television) 신호의 아날로그(Analogue) 파형(波形)을 측정할 수 있는 것</p> <p>4. 벡터 스코프(Vector Scope) 방식 또는 디지털 방식인 것</p> <p>5. 입력 채널(Channel)이 4채널 이상인 것</p> <p>6. 스펙트럼(Spectrum) 분석이 가능한 것</p>
75	9030 9030 9030 9030	31 32 84 89	다기능측정기(Multimeter) 또는 전자부하기(Electronic Rod)	전압, 전류, 주파수, 저항, 압력, 온도 또는 전기신호 중 두 가지 이상을 측정할 수 있는 것

76	9030 9030	33 39	저항 측정기 또는 제베크(Seebeck)계수 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 반도체(복합구조칩을 포함한다), 평판디스플레이 또는 이차전지 연구용으로서, 웨이퍼박막, 글래스기판박막, 필름 또는 분체(粉體)의 저항을 측정할 수 있는 것 2. 스트레스전압의 범위가 100볼트(V) 이상 1,100볼트 이하인 것 3. 시료에 전자빔을 조사(照射)하여 전류를 증폭시켜 비접촉식으로 저항을 분석할 수 있는 것
77	9030 9030 9030 9030 9030 9030 9031	33 39 40 82 84 89 80	네트워크분석기 또는 회로망분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 100메가헤르츠(MHz) 이상의 주파수를 측정할 수 있는 것 2. 동축케이블 연구용으로서 100메가헤르츠 이상의 고주파 대역에서 선로의 전기적 특성을 측정할 수 있는 것 3. 고주파를 반도체소자에 흐르게하여 소자의 주파수 특성 및 임피던스(Impedance)를 분석할 수 있는 것
78	9030 9030 9030 9030	33 39 84 89	주파수 측정기 또는 주파수 분석기	1메가헤르츠(MHz) 이상의 주파수를 측정할 수 있는 것
79	9030 9030 9030 9030	33 39 84 89	전자파측정기 (SAR Scanning System)	1기가헤르츠(GHz) 이상의 주파수를 측정할 수 있는 것
80	9030 9030 9030 9030	33 39 84 89	반도체소자측정기 또는 소스미터(Source Meter)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 평판디스플레이 박막트랜지스터(TFT, Thin Film Transistor) 소자의 전기적 특성을 측정하거나 전기적 신호를 전달할 수 있는 것 2. 전압과 전류의 측정 또는 분석이 가능한 것으로서 기본정밀도가 0.015퍼센트(%) 이상인 것
81	9030 9030 9030 9030 9031	33 39 84 89 80	고전압배터리팩 충·방전기, 배터리 충·방전설비 또는 강유전체 (Ferroelectric) 특성 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 연료전지 또는 차량용 전지팩의 성능을 측정할 수 있는 것 2. 이차전지 또는 연료전지의 충전 또는 방전시험이 가능한 것 3. 절연체의 강유전체 및 정전용량 특성을 측정할 수 있는 장비로서 측정 가능한 분극(Polarization) 이력(Hysteresis)의 주파수 범위가 0.001헤르츠(Hz) 이상 5킬로헤르츠(kHz) 이하인 것

82	9030 9030 9030 9030 9031	33 39 84 89 80	전력 또는 전류 분석기(전력 또는 전류 측정기를 포함한다)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 컴퓨터 제어 방식으로 전력량계의 소요전력을 측정 및 분석하는 것으로서, 입력 채널(Channel) 수가 3개 이상이 거나 측정 오차 범위가 ± 0.05 퍼센트(%) 이하인 것 2. 측정 주파수가 100킬로헤르츠(kHz) 이상인 것 3. 전원특성 및 임피던스(Impedance)를 분석할 수 있는 것 4. 1마이크로암페어(μA) 이하의 전류를 측정할 수 있는 것
83	9030 9030	84 89	전기적 물성(物性) 측정기 또는 임피던스(Impedance) 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 반도체, 이차전지, 연료전지 또는 태양전지 연구용으로서 전기화학적 특성 또는 반응을 측정할 수 있는 것 2. 주파수가 1기가헤르츠(GHz) 이상이고 두께가 1밀리미터 (mm) 이하인 대상 재질의 유전율을 측정할 수 있는 것
84	9030 9030	84 89	통신시험분석기 또는 데이터 통신시험분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 데이터 신호의 비트(Bit) 오류 또는 비트 오류율의 시험 이 가능한 것 2. 통신 프로토콜(Protocol) 또는 지터(Jitter)의 측정이 가능 한 것 3. 유에스비 포트(USB Port) 인터페이스(Interface)를 이용 하는 장치로서 프로토콜(Protocol) 분석이 가능한 것 4. 이피씨(EPC, Evolved Packet Core)와 아이피 멀티미디어 시스템(IP Multimedia Subsystem)을 측정할 수 있는 패킷 (Packet)을 생성할 수 있는 것
85	9030 9030	84 89	소음분석기	주파수 측정 결과 오차 범위가 ± 15 피피엠(PPM) 이하인 것
86	9030 9030	84 89	방사 챔버 (Reverberation Chamber)	100메가헤르츠(MHz) 이상의 주파수를 측정할 수 있는 것
87	9030 9030 9031 9031	84 89 49 80	데이터 수집기, 연속데이터 분석기 또는 진동계측분석기 (Dynamic Signal Analyzer)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 가속도 또는 속도의 동적 신호와, 휘도 또는 색좌표의 광 특성을 계측, 저장 및 분석할 수 있는 것 2. 디지털 방식 또는 컴퓨터 제어 방식인 것으로서 분석 기 능이 있는 것
88	9030 9030 9031	84 89 80	모의시험기, 전자제어장치에몰레이 터(ECU Emulator)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 자동차용 배터리의 충전 및 방전 모의시험을 할 수 있는 것 2. 채널 에뮬레이션(Channel Emulation)이 가능한 것 3. 전자제어장치(ECU)의 소프트웨어를 설계할 수 있으며 자동으로 코드를 생성하고 시험할 수 있는 것
89	9030 9030 9031	84 89 80	논리회로분석기	100메가헤르츠(MHz) 이상의 주파수를 측정할 수 있는 것

90	9030	89	제타 전위 측정기 (Zeta Potential Analyzer)	제타 전위(Zeta Potential)를 측정할 수 있는 것
91	9031	49	응력(應力) 측정기	인쇄회로기판에 접착된 박막·납땀·와이어, 반도체칩(Chip), 반도체소자 또는 평판디스플레이 부품의 응력(應力)을 통하여 탄성율(modulus)을 측정할 수 있는 것
92	9031	49	자동 광학 검사기 (Automatic Optical Inspection)	415밀리미터(mm) × 510밀리미터 이내 크기의 인쇄회로기판 또는 포토레지스트(Photo resist, PR)의 검사가 가능한 것
93	9031 9031	49 80	3차원측정기(비접촉 3차원 측정기를 포함한다), 3차원스캐너, 형상측정기, 진원도측정기 또는 균형측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 레이저를 이용한 방식으로 측정 대상물의 형상측정분해능력이 1마이크로미터(μm) 이상인 것 2. 비전 스캐닝(Vision Scanning)방식 또는 광학(Optical)계측방식을 이용하여 측정 후 그 결과를 3차원 또는 2차원으로 나타낼 수 있는 것 3. 엑스(X)·와이(Y)·제트(Z) 축의 측정범위가 모두 각각 2,000밀리미터(mm) 이상이거나, 탐침자(Probe)의 이송속도가 초당 100밀리미터 이상인 것 4. 리니어 엔코더(Linear Encoder)방식으로 분해능력이 0.01마이크로미터 이상인 것 5. 가로 및 세로의 길이가 각각 450나노미터(nm)이고 높이가 200나노미터인 물체를 측정할 수 있는 것 6. 자동 포커스(Auto Focus) 기능을 가진 것 7. 측정 정도 또는 분해능(Resolution)이 ± 1 마이크로미터 이하인 것 8. 자동차 엔진부품의 형상측정용으로서 분해능이 0.1마이크로미터까지 가능하며 표시정확도의 오차범위가 ± 1.81 마이크로미터 이하인 것 9. 평행도 측정을 위해 0.02밀리미터이하의 분해능이 가능한 것
94	9031	80	공기 유량계	자동차 엔진 연구용으로서 엔진 내 흡기 및 배기 유량 데이터를 컴퓨터 제어 방식으로 수집이 가능한 것
95	9031	80	입자(Particle) 수 측정기	0.3마이크로미터(μm) 이상의 입자를 측정할 수 있는 것
96	9031	80	유전율 (誘電率)측정기 (Dielectric constant, dielectric loss tangent, permeability measurement system)	주파수 측정범위가 10마이크로헤르츠(μHz) 이상 110기가헤르츠(GHz) 이하인 것

97	9031	80	압력 편차 측정기	1미터(m) 당 최대 2,000뉴턴(N)의 압력을 측정할 수 있는 것
98	9031	80	OLED 물성측정기	절대온도 150켈빈(K)이상 350켈빈이하의 온도 조건에서 물성을 측정할 수 있는 것
99	9031	80	전자스핀공명 (Electron Spin Resonance) 측정기	시편에 자기장을 가하여 물질 내의 전자구조에 대한 정보를 분석할 수 있는 것
100	9031	80	변조전달함수 (MTF)측정기	렌즈의 변조전달함수(MTF)를 측정할 수 있는 것으로, 최대 입사각도(Off-Axis)의 범위가 ± 105 도($^{\circ}$)이고 0.5밀리미터(mm) 이상 3밀리미터 이하 범위의 유효 초점거리(Effective focal length)에서 정확도가 ± 5 마이크로미터(μm) 이내 인 것
101	9031	80	피부분석기	피부의 구조, 수분 함유량, 수분 증발량, 유분 함유량, 탄성도, 수소이온농도(pH) 및 온도를 분석할 수 있는 것
102	9031	80	수분투과도 측정기	측정 가능한 수분 투과량이 50제곱센티미터(cm^2)의 면적을 기준으로 1제곱미터(m^2) 당 0.00005그램(g) 이상 5그램 이하 인 것
103	9031	80	접촉에너지 측정기	박막을 냉각 또는 열처리하여 접촉에너지를 측정할 수 있는 것
104	9031	80	족압측정기	보행자의 족압(足壓)을 측정할 수 있는 소자를 256개 이상 갖춘 것
105	9031	80	편심중량 측정기	편심중량 (unbalanced weight)을 0.01그램센티미터(gcm)이하의 분해능으로 측정할 수 있는 것
106	9031	80	화학흡착분석장비	온도는 5도($^{\circ}\text{C}$)부터 85도까지, 상대습도는 0퍼센트(%)부터 98퍼센트까지의 범위에서 환경을 조절할 수 있는 것
107	9031	80	무선계측장치	타이어에서 발생하는 신호[가속도, 스트레인(Strain) 및 온도의 동적신호]를 16채널(Channel)로 계측, 저장 및 분석할 수 있는 것
108	9031	80	초음파 송수신기	측정대상에 초음파를 송·수신하여 내부의 단면을 영상화할 수 있는 것
109	9031	80	전자기식 진동시험기 (Electro Magnetic Vibration Test System)	싸인(Sine) 또는 랜덤(Random) 진동시험을 할 수 있는 것
110	9031	80	수분 함량 측정 장치	수분 함량을 0피피엠(ppm)부터 1,000,000피피엠까지의 범위로 측정이 가능한 것
111	9031	80	기어(Gear)측정기	기어(Gear)의 피치(Pitch), 나선각(螺旋角) 및 흔들림을 측정할 수 있는 것
112	9031	80	기공도측정기(Pore Size Analyzer)	기공율(氣孔率), 공극크기(Pore Size) 분포도, 비표면적, 흡수율, 투과율 또는 압축률의 분석이 가능한 것
113	9031	80	연료소비량 측정기	자동차 엔진에서 소모되는 연료량을 측정하는 것으로서 중량 측정 방식 또는 부피 측정 방식인 것

114	9031	80	생체전기신호 측정기	16채널(Channel) 이상을 지원하는 것
115	9031	80	다각 광산란(Multi Angle Light Scattering) 검출기	측정 가능한 분자량의 범위가 200달톤(Da)부터 1메가달톤(MDa)까지이고, 측정 가능한 분자의 크기가 10나노미터(nm)부터 300나노미터까지인 것
116	9031	80	가스투과도 시험기	차압법을 이용하여 가류(加硫) 고무 등의 시편(試片)에 대한 기체의 투과도를 측정할 수 있는 것
117	9031	80	전자식 수평 충격 시험기	정현반파의 사용이 가능하거나 100중력(G)이상의 최대 가속도를 구현할 수 있는 것
118	9031	80	노면 프로파일 측정 장비	레이저 센서와 레이저 센서 이동을 위한 벨트체인(Belt chain) 및 210센티미터(cm)길이의 레이저 센서의 이동을 위한 기동을 갖춘 것
119	9031 9032	80 89	동력시험기, 동력시험기기 제어기 또는 엔진다이노모 테스트기 (Engine Dynamo Tester)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 와전류형(Eddy Current Type), 직류형(DC Type), 교류형(AC Type) 또는 수력형(Hydraulic Type)으로서 분당 회전수 측정오차 범위가 ± 0.5 퍼센트(%) 이하인 것 2. 자동차, 엔진(가스터빈용 포함) 또는 변속기 시험용으로서 동력흡수 능력이 200킬로와트(kW) 이상인 것 3. 자동차, 선박 또는 자동차타이어 연구용으로서, 컴퓨터 제어 방식으로 동력시험기기 제어 및 데이터수집이 가능한 것 4. 자동차 또는 변속기 시험용으로서 동력흡수 능력이 100킬로와트 이상 350킬로와트 이하인 것 5. 피스톤과 실린더 사이에서 새는 블로바이 가스(Blow-by Gas)와 엔진오일 소모량을 측정할 수 있는 것
120	9031 9618	80 00	인체모형	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 인체 세포와 유사한 젤(Gel) 물질이 주입된 인체 모형으로서 300메가헤르츠(MHz)이상 6기가헤르츠(GHz)이하 범위의 무선 주파수 흡수가 가능한 것 2. 성인의 신체를 모사한 마네킹으로 위생재 성능을 평가할 수 있고, 투명한 실리콘으로 만들어져 주입 상태를 확인할 수 있는 것
121	9406	90	자기설투드챔버 (Magnetically Shield Room and Chamber)	직류(DC) 자장 또는 교류(AC) 자장을 0.03마이크로테슬라(μ T)까지 제어할 수 있는 것

◇개정이유 및 주요내용

기업의 연구 및 투자 활성화를 효율적으로 지원하기 위하여 산업기술 연구·개발용 물품으로서 관세감면대상으로 정하고 있던 133개 품목 중 전기스팀보일러, 가스터빈의 로터 등 41개 품목을 제외하고, 다이부착기, 저온 필터막힘점 시험기 등 29개 품목을 추가하여 총 121개의 품목에 대한 관세를 감면하려는 것임.

<기획재정부 제공>